(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公開特許公報(A)

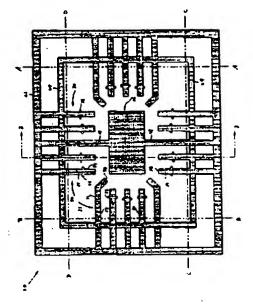
(11)特許出職公開書号 特開2000-150765 (P2000-150765A)

(43)公開日 平成12年5月30日(2000.5.30)

(51) Int.CL*	. 設別記号	FI			テーマコード(参考)		
HOIL 23/50		HO1L 23/50		1	บ ห		
				1			
				1	R		
23/12		23/28			A		
23/28		23/12 F			F		
		密查請求	未辭求	副泉項の数32	36	(全 19 頁)	
(21)出職費号	特級平11-325884	(71)出版人	(71)出版人 599162185				
			アムコ-	ール テクノロ	5°, 1	(ンコーポレ	
(22)出版日	平成11年10月12日(1989.10.12)	ーテッド アメリカ台衆因 アリゾナ州 85248-					
						85248-	
(31)優先権主張書号	09/176, 614	1604, チャンドラー、サウス ブライス					
	平成10年10月21日(1998.10.21)		n- k	1900			
(33)優先權主張国		(71)出版人	5991609	16 5			
		アナム セミコン: チッド		セミコンダク	ンダクタ,インコーポレー		
			200	ソウル 133ーに	20. ス:	ンドンーク。	
			スンス	2 - # 280 -	- 8		
		(74)代理人	(74)代理人 100065916				
			并理士	内原 晋			
		ł	最終更に記			最終更に続く	

(57)【要約】 (貸正省)

【課題】 半導体集積回路の改良型プラスチックパッケージとその製法ならびにそのためのリートフレーム。 【解決方法】 パッケージはダイ、ダイパッド、ボンティングワイヤと割止材とからなる。 全属リードフレーム 20のダイパッド 22 およびリード 30の下側表面はエッチングにより階段状のプロフィルを形成し、ダイパッド リードの凹んだ面を割止材で満たし、リードフレームがパッケージ本体から垂直方向に引き抜かれないようにする。またリードに耳部36を設け パッケージ本体からリートが水平方向に引き抜かれないようにする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】半導体集積回路テバイス用のバッケージで

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部て垂直方向に前記 第1の表面もよび前記第2の表面の間にある実質的に平 面状の第3の表面とを有する全属のダイバットと

前記ダイパッドの前記第1の表面に配置した半導体集積 同路デバイスと

実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の組縁部で垂直方向に前記 第1の表面および前記第2の表面の間にある実管的に平 面状の第3の表面とを各々か有する複数の全席リート

前記半導体集横回路テバイスに設けてある導気性バット と前記金属リードの前記率1の表面との間をそれそれ後 、統する複数の導体と、

の前記第3の表面を覆し、 バッケーン本体を形成するエ ンキャプスレーション材とを含み、煎記金属リードの前 紀第2の表面が前記パッケージの第1の外側表面で露出 し、前記金属リードの前記第1の表面が前記ダイバット の前記第1の平面と同一の水平面内またはその水平面以 下にあるパッケージ。

【論求項2】前記ダイパッドの前記第1の表面が前記金 属リードの前記第1の表面と同一の水平面内にあり、前 紀ダイパッドの前記第2の表面が前記パッケージの前記 第1の外側表面で露出している請求項1記銭のバッケー 30

【鯖木厚3】前記金属リートの前記第2の表面が円形の 周線を育する請求事2記数のパッケーン。

【結水理4】 前記金属リートの前記年2の表面が長方形 の選輯を有する語求項2記載のパッケージ。

【請求項5】前記パッケージの前記率1の外側長面が周 辺部を有し、前記金属リードの全部または複数の一部が その周辺部にある請求項2記数のバッケージ。

【結水準6】前記パッケーシの前記率1の外側表面が回 辺郎を育し、前記全属リートの全部または複数の一部の 40 育記第2の表面が前記周辺部の内側にあって前記エンキ ャプスレーション材を耐記周辺都と前記全局リートの各 ャの前記第2の表面との間に留めるようにする語本項2 記載のパッケージ。

【請求導了】前記周辺部の内側に第2の表面を各ちか有 する前記金属リードが前記金属リードの前記第1の表面 の反対側に実質的に平面状の第4の表面。すなわち垂直 方向には前記を属リードの前記第1の表面と前記年との 表面との間にあり横方向には前記全属リートの前記第章 の表面と前記り、ケーシの前記第1の外側表面の前記用。56、前記フレームの内側に配置されて前記フレームに接続さ

辺部との間にある第4の表面を有する語水項6記載のパ ッケージ。

【請水事8】前記パッケーシが固株側部を有し それら 周韓側部から延びる第1の部分を複数の前記全属リート が有する請求項2記載のバッケージ。

【請求項9】前記全属リートの前記第1の部分が上向さ に曲げてある請求準8記数のパッケーン。

【請求項10】 厨記タイパットの前記第1の表面が周線 都を有し、前記半導体集積回路テバイスが前記タイパッ 10 上の前記回縁部を越えて延びる請求項1記載のバッケー

【請求事】1】 阿記半導体集積回路テバイスが阿記全属 リードの一部を絶えて延びる請求項 1 () 記載のバッケー

【請求項10】前記パッケージが周縁側部辺を有し、前 記半導体集積回路デバイスの側部辺が雨記周線側部辺よ りも約0.1ミリスートル以下内側にある請求項11記 盆のバッケージ。

【請求項13】 阿記半導体集積回路テバイスの第1の側 前記ダイパットの前記第3の表面および前記全属サート 26 部辺、すなわち前記パッケージの固幹側部辺から約0. 6ミリメートル内側の第1の側部辺の近傍の導電性バッ 上に導体を接続した請求項11記載のバッケーシ。

【請求項】4】厚さが約0、50ミリメートル以下の請 水項2記載のバッケージ。

【請求項】5】前記全属リードの前記第1の表面と前記 第3の表面との間の垂直方向の距離が前記金属リートの 前記第1の表面と前記第2の表面との間の垂直方向の距 離の約5 ()%である請求項2記載のパッケージ。

【請求事16】前記金属リードの前記第2の表面がアレ 一状に配置されている請求項1記載のバッケージ。

【請水事17】前紀金属リートの投数の一部が億方向曲 け都を含む請木桶2記載のバッケーン。

【請求項】8】前記全属リートの複数の一部が債方向曲 け部を含む請求項】()記載のパッケーン。

【請求導19】前記ダイバットの前記第1の表面が周縁 部を有し、前記半導体集後回路デバイスが前記ダイバッ Fの前記回縁部を越えて延びる議求項17記載のバッケ - 24.

【請求項20】前記半導体集積回路テバイスが前記金属 リートの一部を絶えて延びる請求項19記載のバッケー

【紡木項21】前記全属リートの前記率2の表面がテレ 一批は配置されていて円形の回縁部を有し、それら全居 リートの複数の一部が横方向曲け部を含む請求項 1 0 記 鉄のバッケーン。

【請木項22】エンキャブスレーションを施した半導体 集積回路パッケーシの製造のための金属リートフレーム てあって、

切り捨て可能な主席フレームと

3/3/03 9 32 Al-

れ、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の 反対側にある実質的に平面状の第2の表面の関鍵部で垂直方向に 前記第1の表面および前記第2の表面の関にある実質的 に平面状の第3の表面とを有する全属のタイパットと、 前記フレームから前記ダイパットに向かってそのダイパー ッドと接触することなくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、その第1の表面の反対側にある実質的 に平面状の第2の表面と一部記第1の表面の反対側にあり垂直方向には新記第1の表面の反対側にあり垂直方向には新記第1の表面の反対側にあり垂直方向には新記第1の表面の反対側にあり垂直方向には新記第1の表面を対側にあり垂直方向には新記第1の表面を対側にあり垂直方向には新記第1の表面を対側にあり垂直が表面とを含む金属サートフレーム。

【鎌水項23】エンキャプスレーションを施した複数の 半導体集積回路パッケージを同時並行的に製造するため のパターニングすみの全国条片であって。

複数の相互接続した切り捨て可能なマトリクス状の複数 の金属フレームと、

解記フレームの各々の内側に配置されてそのフレームに接続され、各々が実質的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面 20 と、解記第1の表面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記第1の表面および前記第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の表面とを有する全属のグィバッドと、

解記フレームの各々から解記ダイパットに向かってそのフレームの中でそのダイパッドと接触することなくそれぞれ延び、実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面と、解記第1の表面の反対側にあり垂直方向には解記第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状の第3の30表面とを含む複数の全属リードとを含むパターニングずみの金属条片。

【請求事24】半導体集長回路テバイスのためのバッケージを製造する方法であって、

リードフレーム、すなわち切り独て可能な全属のフレームと、そのフレームの内側にあってそのフレームに接続された金属のダイパッドであって実質的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面の周は卸て垂直方向に前記第1の表面が出まります。また、前記でレームから前記ダイパットに向かって前記テイパットに指針することを有するリードフレームであって、前記フレームから前記ダイパットに向かって前記テイパットに指針することを有するリードフレームである実質的に平面状の第1の表面の反対側にある実質的に平面状の第2の表面の同様がで無直方向に前記第1の表面の反対側の前記等2の表面の同様がで無直方向に前記第1の表面の反対側の前記等2の表面の同様がで無直方向に前記第1の表面をを各方が有する複数の全属のリートを含むリートフレームを準備する過程

半導体集積回路を3・4.2.を前記タイパットの前記第1の 表面に截置する過程と、

前記半導体集積回路テバイス上の複数のポンティングバットの一つを前記リートの各下の前記第1の表面に電気 的に接続する過程と、

前記半導体集員回路デバイス、前記ダイバットおよび前記リートの前記第1の表面および前記ダイバットおよび前記リートの前記第2の表面を覆い前記リートの前記第2の表面を露出させるようにエンキャブスレーンランはを途布する過程と、

師記エンキャプスレーション材を硬化させる選擇と、 師記ダイバッドおよび前記リートを耐記フレームから切り離し、パッケージ完成品を前記リートフレームから切り離し、前記リードの前記第1の表面を前記タイパットの前記第1の表面と同しず平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置つける過程とを含む方法。

【請求事25】前記エンキャプスレーション材が託記タイパットの前記率2の表面を露出させるように また前記タイパットの前記第1の表面を前記パッケージの前記リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置つけるように金布される請求事24記載の方法。

【請求項26】何記ダイバットおよび前記リートの露出 した前記第2の表面を前記エンキャプスレーション材の 生布役で前記切離しの前に金属でメッキする過程をさら に含む請求項25記載の方法。

【請求項27】前記リードの切断を 切断後の前記リードの各々の第1の部分が前記エンキャブスレーション材の外側に延びるように行う請求項25記載の方法。

【請求項28】前記リードの前記第1の部分を前記パッケージ本体の前記第1の表面に対して上向さに曲げる過程をさらに合む請求項27記載の方法。

【請水車29】複数の半導体集積回路テバイスバッケー シを同時並行的に製造する方法であって。

パターニングすみの金属条片、すなわち複数の使い様で 可能な相互接続すみのマトリクス配列の全属フレームを 合むパターニングずみの全質条片であって、前記フレー ムの各々の内側にあってそのフレームに接続され 実質 的に平面状の第1の表面と この第1の表面の反対側に ある実質的に平面状の第2の表面と「前記第1の表面の 反対側の前記率2の表面の風味部で垂直方向に前記第1 の表面および前記第2の表面の間にある第3の表面とを 古とが合む全国のタイパットを有するとともに、前記で レースの各々からそのフレームの前記タイパットに向か って前記タイパットに接触することなくそれぞれ騒び 実験的に平面状の第1の表面と、この第1の表面の反対 側にある実質的に平面状の第2の表面と、前記第1の表 面の反対側の前記第2の表面の周縁部で垂直方向に前記 第1の表面および第2の表面の間にある実質的に平面状 の第3の表面とを召りが有する複数の金属のリートを有 36、するハターム。とすみの金属条片を準備する過程と

前記半導体集長回路テバイスの各ヶの上の複数のホンテ ィングパットの一つをその半導体集機回路テバイスと同 一のプレーム内の一つのサートの前記第1の表面に意気 的に接続する過程と、

前記半導体集操回路デバイス。前記ダイバットおよび前 記リードの前記率1の表面および前記ダイバットおよび 前記リートの前記第3の表面を覆い前記リートの前記第 2の表面を露出させるようにエンキャプスレーション(す を盤布する過程と、

前記エンキャプスレーションはを硬化させる過程と、 再記ダイパットおよび前記リートを前記フレームからそ れそれ切り難し 複数のパッケージ完成品を前記主席条 片から切り難し 前記パッケージの各々の前記リードの 前記第1の表面を前記ダイバットの前記第1の表面と同 じ水平面内またはその水平面よりも低い平面内に位置づ ける過程とを含む方法。

【鏑木項3()) 前記エンキャプスレーション材が新記タ イパッドの前記第2の表面を禁出させるように また前 記ダイパッドの前記第1の表面を前記パッケーンの前記 リートの前記率1の表面と同じ水平面内に位置づけるよ。20 ーション材などがある。 うに僅而される請求項29記載の方法。

【論水項31】半導体集積回路バッケーシを製造するた めの金属リードフレームを製造する方法であって 全国再板を準備する過程と

前記全席帯板の所定部分を除去して フレームとそのフ レーム内にあってそのフレームに接続されているダイバ ッド、すなわち実質的に平面状の第1の表面とその反対 側の実質的に平面状の第2の表面とを含むダイバッド と、薊記フレームから前記第パットに向かってそのダイ パッドに接触することなくそれぞれ延び各ヶが実質的に 30 平面状の第1の表面をよびその反対側の実質的に平面状 の第2の表面を含む複数のリートとを含むリートフレー ムを形成する過程と、

前記リードフレームの前記タイパットおよびリートの一 方の側の所定の部分にパターニングすみのフォトレジス トマスクを塗布する過程と

前記ダイパッドおよびリートの一部を化学的にエッチン グして前記ダイバッドおよびリートのマスクなしの部分 を除去し前起タイパットおよび前記リートの各々に実質 的に平面状の第3の表面。すなわら前記タイパットの前。40 記事1の表面の反対側にあり前記タイパットの前記第2 の閣構で垂直方向に前記タイパットの前記第1の表面と 前記第2の表面との間にある前記タイパットの第3の表 面。および前記リートの各々の前記率1の表面の反対側 にあって垂直方向に前記リートの前記率1の表面と前記 リードの前記第2の表面との間にある前記リートの第3 の表面を形成する過程とを含む方法。

【鯖木椰32】前記除去する過程がパターニングすみの フォトレジストマスクを前記全居海飯に宝布する過程。

仮の所望の部分を除去する過程とを含む請求項31記載 の方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

(発明の属する技術分野) 本発明は半導体集積回路? イーすなわら半導体集積回路チップのための改良型プラ スチックパッケージ。およびこの役のパッケーンを製造 するための方法およびリートプレームに関する。 [0002]

【発明が解決しようとする課題】半導体集積回路チップ は、有害な環境からの保護および集積回路・印刷配接回 路芒板間の電気的相互接続のために プラスチックパッ ケージに通常密封する。この種のパッケージの構成要素 としては、全国リードフレーム、半導体集積回路チッ プーその半導体集積回路チップをリートフレームに付着 させる結合材 半導体集積回路チップ上のコンタクトバ ットをリートフレームの個々のリートに電気的に技統す るホンディングワイヤもよびこれら素子を覆ってハッケ ーン外線を形成する硬質プラスチックのエンキャプスレ

【0003】リードフレームはこの種のパッケーシの中 心的な支持構成物である。リートプレームの一部はパッ ケージの内側にあり、プラスチックのエンキャプスレー ション材に完全に取り囲まれている。リートフレームの リートの一部はバッケージから外部に延びてバッケーシ の外部接接に用いられる。

【() () () 4 】 慎用のプラスチック集長回路パッケージお よびリードフレームに関するさらに評しい背景倫報はニ ューヨーク州ニューヨーク市フィフスアヴェニュー11 4所在のVan Nostrand Reinhold 性1989年発行のR. TummalaおよびE. R ymaszewski井橋の専門書「Microele ctionic Packaging Handbee k」の第8章に記載されている。

【0005】従来のプラスチックパッケージの問題点 は、内部のリードフレームのためにバッケーシの小型化 が制限されることである。Rocheほか名森の木国特 許事4、530、142号ねよびCastroS級の米 国特許第5、172、213号に記載されているとお り 当業者はリートフレーム除去によるバッケーン小型 化を試みたが、それらパッケーシは多数の欠点を伴う。 上記米国特許第4、530、142号記載のバッケージ のコンタクトは直交の側面を育する。したかって、コン タクトがエンキャプスレーション材から容易に引きばか されてバッケーンの信頼性が低下する。上記米国特許第 5、170、213号記載のパッケージは集積回路チッ プ上のパットから上方に垂直に延むる曲げリートを備え る。このようなサートをバッケーシ内に合むので製造コ ストが上がり、バッケージの小型化が阻塞される。した と、前記全席商校を化学的にエッチングして前記主席荷。50、かって、より小さくより信頼性の高いプラスチックバッ ケージが必要である。

[0006]

【課題を解決するための手段】この発明は半導体集積回 路チップを収容する改良型プラスチックバッケージ、お まびそのバッケージの製造のためのリートフレームおよ び方法にある。この発明の一つの実施例による根立て方 法における工程」では全国リートフレームを準備する。 そのリードフレームは切り様で式の長方形のフレームを 含む。ダイバットをそのフレームの中に設けてあり、そ のリードがダイパッドとの接触なしにダイパッド方向に 延びている。

【0007】リードフレームのダイバットは長方形の田 辺を有する。ダイパッドは水平な第1の表面を有し、パ ッケージ組立ての際にその上にダイを載せる。この第1 の表面の反対側には実質的に平面状の中央部の第2の表 面があり、周辺部の第2の表面がある。この第3の表面 は第2の表面の風味にあり 第2の表面から垂直方向に 凹んでいて、ダイバッドの下側表面が降段状のプロフィ キャプスレーション材がダイバットの上記の凹んだ第3 の表面の下側を歳たしているがダイバットの第2の表面 は覆っていない。ダイパットの第3の表面の下のエンキ ャプスレーション材はダイバットがパッケージから垂直 方向に引っ張られるのを防止する。

【0008】各リードは第1の表面と この第1の表面 の反対側の第2の表面と 同様に第1の表面の反対側で 第2の表面の近傍の第3の表面とを備える。第2の表面 は長方形または円形の四線を有する。第3の表面は階段 状プロフィールのリードの下側表面に至る第2の表面か 30 **与垂直に凹んでいる。パッケージ完成品ではリートの第** 3の表面の下をエンキャプスレーション材が満たしてい るが、リードの第2の表面を覆ってはいない。リートの 第2の表面はLCCパッケーシの場合と同様にバッケー ジの外部接続のためのコンタクトとして、または半田林 の技能のためのランドとして作用する。リードの年3の 表面の下のエンキャプスレーション村はリードがパッケ ージから垂直に引っ張られるのを防止する。

【① ① ① ②】 リートフレームは色いた主席条片から2工 程温式エッチングにより形成する。第1のエッチングエー40 程は金属灸片をエッチングで貫通する片面または両面エ ラチングであって、それによって、リートフレームの所 望の全体パターンを全居条片に転写する。第2のエッチ ング工程はダイの周辺およびリートの所定部分をエッチ ングする工程である。第2のエッチング工程はダイバッ ドおよびリードの厚さの一部をエッチングし、それによ って上述の垂直方向に凹んた平面状または実質的に平面 状の第3の表面をタイパットおよびサートに形成する。 【0010】工程でではタイパットの上側の第1平面の 上に半導体集構回路を載せる。用途に応じて、タイで面(50)は、バッケーンをチップと同時の大きさにすることもで

構はダイバットの第1の表面の面積よりも小さくする か、またはダイバットの風味部からダイがはみ出すよう に大きくしても差し支えない。

[00]]] 工程3はダイのポンティングパットの各っ と各リートの第1の表面との間をポンティンクワイヤま たは同等の導体で電気的に機械する。ボンディングワイ かの技術を受けるリート部分は、例えば説、全その他の 全属でメッキしておく。

【りり】2】工程4はタイおよひリートフレームの上向 のフレームに接続してある。フレームから構方向に複数 10 さの集1の表面に高粘性の粘着性エンキャプスレーショ ン村を供給する。この工程のあとエンキャプスレーショ ン計は硬化する。このエンキャプスレーション計は、タ イーホンディングワイヤーリートの第1の表面 ダイバ ットおよびリートの第3の表面、およひダイおよびリー 下の側面を覆う。 タイパットおよびリートの第2の表面 はエンキャプスレーション社には覆われず、バッケーシ 下側外表面で露出している。

【0013】工程5においては、ダイバットおよびリー Fの露出した準2の表面などのリードフレーム露出表面 ールを示すようにしてある。パッケーン充成品ではエン 20 を 順、金、鉛-亜鉛半田、4株、ニッケル、パランウム ほか半田付け可能な金属で半田付けする。用途およびり ードフレーム针科によっては、工程5は省略できる。 【0014】工程6において、パッケージ完成品をエン キャプスレーションずみのリートフレームから切り離 す。より詳細に述べると、工程6はリードフレームの切 り捨て可能部分を除去する。すなわち 長方形リートフ レームなどのリードフレーム切り捨て可能部分をダイバ ッドおよびリードなどリードフレームの部品構成部分か 方切り載す。工程 4 におけるエンキャプスレーン 3ンの 方法によっては、工程6でエンキャプスレーション材を 切ってパッケージの周辺を形成する。

【0015】工程6はリートフレームからリートを切断 する。この切断はダムバーの内側で行う。切断の場所に 応して、切勘すみのリートの建都がバッケージの側部が ら慎方向に延びる。工程6またはその後様の工程に、パ ッケージ側部で上記切断リードの突出複都を上に曲げて リート機能がパッケージ下側外面におよびリードのエン キャプスレーション部分に傾斜角を成すようにする曲げ 工程を含めることもできる。バッケージを印刷配線基板 に半田付けする際に、バッケージ下側外面に露出したり ート水平部だけてなく切断リートの上向き曲げ篠部にも 半田を付けて、半田接続を務めるのである。 バッケージ の主側表面は、バッケージ下面中心にあるタイパットの 第2の表面、リートの第2の表面およびバッケージの下 面の残余部分を形成しタイパットおよびリートを互いに 分離する硬化すみのエンキャプスレーション材を含む。 【10.0.1.6】この発明のバッケージは多数の利点を確。 え、大島カデルイスやアナログデバイスなど多数の用途 に有用である。このパッケージは小型化できる。例え

3/3/03 9 33 AM

きる。また、バッケージをごく薄くすることもできる。 この発明によると、厚さり、ちミリメートル以下のパッ ケージも製造できる。さらに、リードをダイのごく近傍 に配置してポンティングワイヤの長さを最小にすること がてさる。ダイハットの露出した第2の表面を ハッケ ージ治却に備えて半田で印刷配線差板に結合することも できる。

【0017】上述のリートフレーム バッケーンおよひ 組立て方法の多数の変形をこの明細書に記載するか。こ れらはいずれもこの発明の一部を構成するものである。 例えば、一つの代替的組立て方法では複数のパッケージ の同時並行的製造を可能にするリードフレームを用い る.

f00181

[発明の実施の形態] 図] はこの発明による半導体集積 回路テバイスバッケージ組立て方法の流れ図である。図 5は図1の方法で製造可能なこの発明によるパッケージ の実施例を示す。

【0019】図1の工程1において全属フレームを準備 する。図2はこの発明によるリートフレーム20の平面(20)絡み合い、パッケージ本体からリート30が水平方向に 図である。リードフレーム20の金属部分をそれら金属 部分以外の空間から区別するように図2(ほかの図も同 じ)では陰影を付けて見やすくしてある。

【0020】図2のリートプレーム20は、用途に応じ て、銅、銅台糸(メッキ鋼)メッキ鋼合金、台糸37 (ニッケル37%、娘55%の台金) 網メッキ鋼なと 慣用のリードフレーム台金で構成する。

【0021】図2のリードフレーム20は周辺部の長方 形タイパー21と中心寄りの長方形のダムパー29とを 備える(「長方形」が「方形」を含むことは当業者には、30 たは実質的に水平の表面を含む。 明らかであろう)。 複数のリートフレーム20を至薦条 片にエッチングで形成したもの(何えば図16年曜)な ど代替的実施例(図示してない)ではタイパー21を省 點してリードフレーム周辺部を験後リートフレーム間の 金属条片の一部で形成することもできる。 もう一つの代 營的実施例 (四示してない) ではタイパー21とタイパ ー21・ダムパー29間リード部分とを省略して、リー ドフレーム外側フレームをダムパー29て構成すること もできる。

パー21に接続してある。タイパット22はタムバー2 9の内側にある。二つの技統線で8がタイパットででを ダムハー29およびタイパー21に接続している。図1 の工程6では、接続線30をダムバー29の内側でリー ドフレーム20から切り離す。

【0023】タイパー21からダムバー29経由てダイ パッド22の側面に向かって18字のリート30かタイ パッド22との接触なしに損方向に延びている。 高りー ト30の第1の複都34はタイパット22の近傍に位置 する。図1の工程6において、名りートはタエバー29~56~部接続のために十分な方さらにする。乗りの表面39は

とリート30の単1の端部34との間で切り難される。 代替の実施例(図示してない)では、リート30をタイ ハー21起点でなくダムバー39起点で設けることもで き。またダムバー2.9 およびグイバー2.1 を複数の対称 配置条片で接続することもできる。

【0024】図2に示したサートプレーム20のサート 30の位置もよび横方向経路は例示にすぎない。 これら リートの数。位置および推方向経路は用途によって変わ る。この発明の利点は特定の半導体業績回路タイのナン ディングパットの故および位置に柔軟に対処するように 設計できることである。

[0025] 図2の18本のリート30のうち14本は 直棟状である。これらリードのうち4本はダムパー29 とダイパット22との間に債方向曲げ即を含む。直接状 リート30の各々は、そのサート30の精制面から垂直 方向に突出したアンカー耳部36を有する。アンカー耳 部はほぼ長方形であり、階核リートとうしの間で配置を 少しずらしてある。 バッケーシ芫成品ではこれらアンプ 一耳部3.6はパッケージのエンキャプスレーション材と 引き抜かれることがないようにする。アンカー耳部の代 わりにリード30中の賞通孔または凹みをエンキャプス レーション材との絡みに用いることもできる。

【0026】図3は図2の練3-3で見たダムバー29 の平行部は内のリートフレーム20の断面図である。 2 イバット22ねよび二つの互いに相対するリート30分 示してある。図示したリート30の各部分はタムハー2 9のすぐ内側から始まっている。 ダイパット22および リード30の両方の下側表面は垂直方向に凹んた十平ま

【0027】図3のダイバットごごは平面状の上側の第 1の表面23 平面状の反対側の第2の表面24をよび 平面状の間じく反対側の第3の表面2.5を含む。これら 表面と直交する第1の側部表面27か年3の表面25と 第2の表面24との間にある。第3の表面25は第2の 表面24から深さ「H1」だけ垂直方向に凹んている。 すなわち、第3の表面25は垂直方向には第1の光面2 3と第2の表面24との間に位置する。 タイパット22 の中央部分は第1の表面23と第2の表面24との間の 【0022】長方彫岡様を有するダイバット22をタイニ40 高さ「目」を有する。タイパット22の第3の表面25 は第2の表面24の回縁部にあり、一つの実施例ではこ の第2の表面24を取り個人でいる。

【0028】図3のリート30の各々は平面状の第1の 表面31を含む、第1の表面31の反対側には平面伏の 第2の表面32および平面状の第3の表面33かある。 第2の表面32はタムバー29から始まりタムバー29 の内側でタイパットな2に向かって少し延びる。この裏 絶例では、第2の表面32は長方形の周縁を有する。第 **2の表面の長さは用途によって変わるか。バッケーシ外** 第2の表面32とリート30のタイパット22近傍終緯34との間で延びる。第3の表面33は第2の表面32から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。アンカー耳部36(図示してない)がリード30の第3の面33近傍の億方向側部から垂直に延びている。

【0029】図1の工程6では、リートでレーム20のエンキャプスレーションのあと、リート30をダムパー29の内側で図2の直根AーA、BーB、CーCおよび 10DーD沿いに切り離す。この切断はリート30の率2の表面32を含む部分で垂直方向に行う。パッケージ充成品では、切断されたリード30の各々の第2の表面32がパッケージを直接的または間接的に外部の印刷配根基板に接続するパッケージコンタクトとして作用する。パッケージ完成品ではリート30の第3の表面33はエンキャプスレーンョン材で置われ、したかってパッケージ本体の内側にある(図5)。

【0030】図3のリードフレーム20のダイバッド22およびリード30の高さ「H」の数値例としては、約20.15万至0.50ミリメートル 凍さ「H1」の数値例としては約0.075万至0.25ミリメートルが動けられる。ダイバッド22の水平方向インデント「W」の数値例としては約0.025万至0.25ミリメートルが動けられる(これらの数値は図中「H」「H1」「W」で示した部分にも適合する)。百分比でいうと、「H1」の値は「H」の値、すなわら第1の表面23および31と第2の表面24および32との間の距離「H」の33%万至75%の範囲または約50%である。実際の数値は用途によって変動する。

(0031) 図2のリードフレーム20は色取り至席条件から復式エッチングによって形成する。 知知の通り、化学のエッチング(化学のミリング)は、フィトリンクラフィ、フィトレジスト および全属溶解液状化手物質を用いて全属条件にパターンをエッチングで形成するプロセスである。 通常は、まずフィトレジスト度をその金属条件の片面または両面に付着させる。次に、そのフィトレジスト度を現像して硬化させ、パターニングしたフォトレジスト度を現像して硬化させ、パターニングしたフォトレジストである。 大に、このマスク形成するの条件の片面または両面に化学物質を吹き付けその他の方法で作用させる。 全属条件の露出部分はエッチングで辞去され 全属条件には所望のパターンが残る。

【0032】図2および図3(図9 図13、図15および図16も同様)のリートフレーム20を形成するのに二段階エッチング処理を用いる。第1のエッチング工程では、全属条件の平面状表面の片面または両面に付着させたフォトレジストパターンにしたかってその条片の片面または両面がらエッチンとを進かる。この第1のエーの

ッチング工程で、全居条片の踏部分を完全に除去し、図 2に例示したとおり、リートプレームの全体的なパクー ンを形成する。次に、ダイバットの風味部およびリード の所望部分を第2のフォトレジストパターンで覆わない 主主武出させ エッチング除去に迫した状態にする。第 2のエッチング工程ではこの第2のフォトレシストパタ 一ンにしたがって一方の側からリートフレームの厚さ方 向一部を耕去する。この第2のエッチング工程で 図2 および図3のリートフレーム凹み面。 すなわらタイパッ 122の第3の表面25およびサート30のダムバー2 9内側の第3の表面を形成する。ダムバー29の内側で は 通常は接続線28もこの第2のエッチング工程にか ける。ダイバッドおよびリードの所望部分の所望の厚み がエッチングで除去されると、この第2のエッテングエ 程を止める。すなわち、この第2のエッチング工程はダ イバットもよびリートの所望の部分を厚さ方向に部分的 にエッチング除去する。寒2のエッチング工程によるエ ッチングの深さは、ダイパッド22およびリート30を パッケーシ本体に留めるに十分な量のエンキャプスレー ション材がダイバット22の第3の表面25およひリー ト3()の第3の表面33の下を流れるようにする必要を 湖たす鍵とする。 通常は第2のエッチング工程でダイバ ッドおよびリードの厚みの約5.0%を除去するが、この 値はダイパッドおよびリードの厚みの約3.3%乃至7.5 %の範囲で定められる。エッチング処理のばちつきのた めに 第3の表面25および33は平面状でなくほぼ平 面状になるに留まり、ダイバッド22およびリート30 のエッチングした側壁は90°でなく丸みを帯びた角部 を伴うこともあろう。

(1)033)リードフレーム20の形成を、順送り行抜さにより全体的パターンを形成する工程と、行抜さすみリードフレームのダイパットおよびリードを上述の化学的エッチングにより解み方向に都分的に凹み表面を形成するように除去する工程とにおいて半導体集積回路タイラ2をダイパット22の第1の表面23の中央に敵せる。パッド22へのダイ52の裁擬および付着は慣用のタイ付着マシンおよび慣用のダイ付着エボキシによって行うことができる。この工程2およびそれ以降の組立て工程の期間中は一回2のリードフレーム20を許電放るに対するダイ保険のために接地しておく。

【0035】図】の工程3では、半導体集積回路タイ52(図5)上の個々のポンティングパットと個々のリート30の第1の表面31との間を導電性金属ホンティンクワイヤ54またはその同等物で電気的に接続する。第1の表面31は金、銀、ニッケル、パラジウム 網その他の全属でメッキすることもできる。図2のリートアレーム20は、評電飲意による半導体集積回路デバイスの積得を防ぐためにこのホンティンクワイヤ接続工程の期間中は接地しておく、

【0036】図1の工程4では、図2のリートフレーム 20に斉枯性の貼着エンキャプスレーション材を入れ る。エンキャプスレーション材は半導体集積回路ダイ5 2.ポンディングワイヤ54、ダイバッド22の側方表 面26および27、ダイバット22の第1の表面23お よびダイ3の表面25、リード30の第1の表面31、 第3の表面33ねよび側方表面を覆う(図5)。タイパ ッド22の第2の表面およびリート30の第2の表面3 2はエンキャプスレーション材には属われてなく異出し たままである。代替的実施例では、ダイパット22をエー10 ンキャプスレーション工程のあいた裏返しにして ダイ パット22の年2の表面24の下にエンキャプスレーシ ョン村の薄い唇が形成されるようにする。その実施例で は、ダイパット22はパッケーシ本体の内部に全体が入 る。最後にエンキャプスレーション村を硬化させる。 【0037】図1の工程4を行うには用途に応じていく つかの方法がある。例えば 図1の工程4は信用のブラ スチックモールド手法を用いて行うこともできる。その 手法では、図2のリードフレーム20を型の中におき、 図4に示すとおり、リードフレーム20の上に固体成型(20)のリードフレーム20の料視図である。この例では、工 エンキャプスレーション村プロックを形成する。このエ ンキャプスレーション材は慣用の手法を用いて導入した 慣用のプラスチックモールド材料である。 このモールト 材料としては 日本の日東電工から市販されているモー ルド村日東MP-8000ANおよび住友から市販され ているモールド村EME7351UTなどが挙げられ る。モールド処理の円滑化のため、リードフレーム2() に慣用のゲートを設けることもできる。型の側面は完成 品取出しを容易にするためにテーパー状にする。

13

【① 0 3 8】工程4のモールド処理の代わりに工程4を 30 液状エンキャプスレーション材の利用によって行うこと もできる。例えば、図2のリードフレーム20をまず水 平長面上におく。第2のステップとして、カリフォルニ ア州インダストリー所在のDexter-Hysol社 市販のHYSOL4451エポキシなど慣用の硬化可能 な高粘性粘着材の互いに開接するピーズをリードフレー ム20に塗布して、ダイ52の周囲およびリード30の 少なくともダムバー29内側部分に関じた長方形のダム を形成する。第3のステップとして、140℃で1時間 加熱してそのビーズを硬化させる。第4のステップとじ(40) て、HYSOL4451液ポエンキャブスレーション材 などパッケージのエンキャブスレーションに迫した慣用 の硬化可能な高粘性粘着材をピースの内側に塗布してク ム内部の不完全なパッケージをエンキャプスレーション 材で覆うようにする。最後のステップとして、140℃ で1時間加熱してエンキャプスレーション材を硬化さ せ、リードプレーム20上にエンキャプスレーンコン材 の一つの固体プロックを形成する。この手法を工程4に 用いた場合は、工程もは底を用いてエンキャフスレージ

にリートフレームからパッケーシ完成品を切り離す。同 棒のモールト処理およびそれに続く個によるリートフレ ーム・パッケージ切断工程は1998年6月24日提出 の米国特許出験第0.9/103.760号に記載されて おり ここに参照してその記載内容をこの明細書に組み 入れる。

(0039)図1の工程5では、図2のリートフレーム 21)の締部分のうち、ダイバット22の第2の表面2 4 リート30の第2の表面32などエンキャプスレー ション材で覆われない部分を、印刷配検益板と両立性あ る慣用のメッキ金属でメッキする。このメッキ金属の例 としては、用途に応じて至。ニッケル、パラジウム、イ ンコネル、鉛糯半田、タンタルなどが挙げられる。リー トフレーム21)の形成に用いた金属がメッキを要しない 全属またはメッキずみの全属である場合は工程5は省略 てきる。例えば リードフレーム20形成用条片がニッ ケルパラジウムメッキを超した銀である場合は 工程5 は省略する。

[0040] 図4は図1の工程1-工程5終了後の図2 程4にモールト処理を用いている。硬化したエンキャブ スレーション村のプロックがパッケージ本体51を形成 する。パッケージ本体5~のテーパー付き側面5.5はク ムバー29の内側にある。したがって、リード30の雲 出部分はパッケージ本体51の側面51とダムバー29 との間で延びている。

[0041] 図1の工程6はエンキャプスレーションず みのリードフレーム2() (図4) を図2の棟AーA、B - B. C-CおよびD-Dで切断する。図2を参照する と 工程6はダムバー29の内側でリード30を切り離 す(図3)。工程2も接続棟30をダムパー29の内側 で切り離す。最後に、工程6はパッケージ完成品をリー トプレーム20の切り捨て可能部分から切り難すことに よってパッケージ形成を充了する。

【0042】工程6はパンチ、紀または同等の時断鉄品 を用いて行う。例えば、パッケージ本体35が図5に示 すようなモールド休である場合はパンチまたは底を用い る。パンチを用いる場合は、パッケージ完成品を単一の パンチ動作でリードフレーム20から切断する。バッケ ージを反転させて、タムハー29の内側でリート30を パンチで切断する。切断の位置は、パッケージ側面5.5 から延びるリート30の切断部分が長さ巻ミリメートル から例えばり、ちミリメートルの範囲に入るように変え ることができる。

【0043】図5はこの発明によるバッケージ完成品5 0の断面図である。バッケージ充成品50は図2のリー トプレーム20で製造し、図4の状態からパンチで切り 難したものである。 バッケージ5 0のバッケーシ事体5 1はモール1で形成してある。バッケーシ5のは平面状 ョン村を切断し、直交パッケーシ側面を形成するととも、50。の宇側の第2の表面52とデーバ付き側面55とを有す 【0044】図2のリートフレーム20から製造したパッケージ50の構造と整合して、図5のパッケーン50のダイパッド22はほぼ平面状の上側の第1の表面23を有する。ダイパット22のこの第1の表面23の反対側には、ほぼ平面状の第2の表面24と同様にほぼ平面状の風体部の第3の表面25とがある。第3の表面25は第2の表面22を取り回んでもりその第2の表面22

15

は第2の表面22を取り回んでおりその第2の表面22 から垂直方向に凍さ「H1」だけ凹んでいる。第3の表面25は垂直方向には第1の表面23と第2の表面24 10 との間に位置し パッケージ本体51形成用のエンキャプスレーション村で援われている。第3の表面25の下のエンキャプスレーション村はダイバッド22がパッケージの長面方向に引っ張られるのを防ぐ。第2の表面22はパッケージ50の下側表面56で高出し したがってパッケージ50の下側の第2の表面56の一部を形成する。代替的実施例では、ダイバット22はパッケージ本体の内部に完全に含まれる。

【0045】図5において、半導体集長回路ダイ52は 関面55から後方向にはみ出され ダイパッド22の第1の表面23に付着させてある。ダ 20 図55でリード30を切断する。 イ5.2のボンディングパット53の各々とリート30の 【0051】代替の実施例(図デ第1の表面との間をボンディングワイヤ54で検索す ド30の切離しずみ建部35をパ 水平面内で横方向にはみ出させる

【0046】図5のパッケージ5のは複数のリード3のを含み、これらリードの各々は図2のリートフレーム2のから第2の表面32のダムパー29の内側の点で切り離したものである。切り離されたリード3の配置と数はパッケージ製造に用いたリードフレームおよび用途に応じて変わる。例えば、図2の場合のようにリード30には重複状のものも曲げ部を含むものもある。

【0047】図2の場合と同様に、切り難しずみのリード30の各々はほぼ平面状の第1の表面31と その反対側のほぼ平面状の第2の表面32と 同様に反対側のほぼ平面状の第3の表面33とを含む。第3の表面33はエンキャプスレーション村による被覆を受けるように第2の表面32から覆さ「H1」だけ垂直方向に凹んでいる。すなわち、第3の表面33は垂直方向には第1の表面31と第2の表面32との間に位置する。リード30の第2の表面32はエンキャプスレーション村には覆われず、パッケージ50の下側表面56で露出する。

【0048】図5において、リート30の第1の表面31の5ちパッケージ本体51の内部にある部分はタイパッド22の第1の表面23と同し水平面内になる。タイパッド22をモールト内で上に上げた構造の代替の実施例(図示してない)では、リート30の第1の表面31の5パッケージ本体51の内部にある部分は上がったダイパッド22の第1の表面23よりも低い水平面内にある。

【0049】図5の切り離しずみのサートさりの各々は パッケージ側面55から横に延びる切断端部さらを含 み、リート30の第2の表面32の核条の水平部分およい下側パッケージ表面56に対し傾斜角分を成すように曲げてある。角度分は約15、乃至70、の範囲に数定できる。図示のとおり、リード30の率2の表面32の上向き曲け終端部35は露出している。リード30のこの曲げ終端部35の長さはパッケーン側面55から倒えば0、15ミリメートルであるが、用途に応じてこの数値は変えることができる。その数値面回は数ミリメートルから約0、50ミリメートルである。

(0050) 図5のリード30の曲げ終端部35の上向きの曲げ部は工程6においてパッケージ50をリートフレーム20からパンチ操作で切り離すスタンピングマジンで形成できる。代替の実施例(図示してない)では、リード30の終端部35をパッケージ側面55に接触するように、すなわら角度を未不面とデーパー付きパッケージ側面55との成す角度と等しくするように曲ける。さらにもう一つの代替実施例(図示してない)では、図1の工程6で、リード30の切断端がパッケージ側面55から慢方向にはみ出さないようにパッケージ側面55でリード30を切断する。

[0051]代替の実施例(図示してない)では、リード30の切離しずみ雑部35をパッケージ側面55から水平面内で横方向にはみ出させる。すなわち、切離しずみの確部35を図5の場合のように曲げるのでなく、角度もが零度に等しくなるようにリート30の残余の部分と関し水平面内で横方向に延ばすのである。上記工程6で据を用いた場合にそのようなパッケージが得られる。工程6に認を用いた場合は、必要に応じて曲げ工程を別に退加して図5の形状の上向き曲げを形成する。

30 【0052】図6において 半田パンプ57をパッケージ50と印刷配牌基板(図示してない)との間に付着させる。半田パンプ57はリート30の年2の表面32に接触し、リート30の曲げ接部35を覆っている。

(1)053)代替の実施例(図示してない)では、グイバット22の露出した第2の表面24を半田ペーストなどで印刷配修管板に収載的に接続してバッケージ格却に備える。この格却は熱伝導により行われる。

【0054】図7は図5のパッケージ50の下側表面56を示す。パッケージ50の第2の表面56はタイパット22の第2の表面24と「切断ずみのリート30の第2の表面32と「硬化すみのエンキャブスレーションほどから成る。リード30の切離しずみ終端が35は下側接面56の機からわずかに延びている。第2の表面32は用途によって円形その他の多様な形状と寸法にすることができる。ダイパット22の第2の表面24は長方形の風煙を有するが、それ以外の形状にすることもできるの風煙を有するが、それ以外の形状にすることもできる。

【0.05.5】図7では、リート20の第2の表面30を50 パンケーシ50の下側表面56で24合いに整列配置して

ある。リート30の切離しずみの終編部35は下側表面 56の周縁から少し延びている。図8は代替的パッケー ジ6 ()の下側外表面 6 1 を示す。 図8 では、切離しずみ リード63の舞出した長方形の第2の表面64(図9) をパッケージ61)の下脚表面61の傷の少し内側で一列 に並べてある。これら第2の表面64はパッケーン60 の下側表面の風味から例えば約0.05ミリノートルの 位置に配度するが、この数値は用途によって変わる。代 着の実施例(団示してない)では、年2の表面64は長 を形成する。

[0056] 図9は図8のバッケージ60を製造するた めのリードフレーム62のダイバッド22およびリート 63のダムバー29の内側で見た断面図である。図9の リードフレーム62は図2 および図3のリートフレーム 20とほぼ同じであり、リート63の垂直方向に凹ませ た下側表面の配列、数および位置を除いてリードフレー ム20と同じ方法で製造する。したがって、宣復説明は 省略する。

リード63はほぼ平面状の第1の表面31と同様にほぼ 平面状の反対側の第2の表面64とを含む。第2の表面 64はパッケージの外部コンタクトとして作用する。し かし、図2および図3のリードフレーム20の第2の表 面の場合と異なり、図9のリート63の第2の表面64 はダムバー29(図2)のすぐ内側またはすぐ近傍には 位置せず、リード63の第3の表面6643とび第4の表 面65の間でダイバッド24により近く位置している。 第3の表面66と第4の表面65は第1の表面31と反 対側にあり、ほぼ平面状であり、同一平面内にあり、リー30 ード63の第2の表面64から深さ「H1」だけ垂直方 向に凹んでいる(すなわち 垂直方向には第2の表面3 1と第2の表面64との間にある)。第4の表面65は 横方向にはダムバー29(図示してないが図2の場合と 同じ)と第2の表面64との間にあり、第3の表面66 は第2の表面64とダイパッド22との間にある。

[0058] 図8ねよび図9のリード63の第2の表面 6.4の回縁は多様なパッケージ外部技術を容易にするよ うに多様な形状にすることができる。例えば、この第2 の表面6.4 は図8の場合のように長方形の回縁を備える。 形状にすることができ、また円形の周線を備える形状に ずろこともできる。

【0059】図10は図8のバッケーン60の断面図で ある。図10のバッケージは図1の処理に従い、図9の リードフレームを用いて製造する。図示のとおり 第4 の表面65はパッケーシ側面55に階級し、第2の表面 はパッケージ60の下側表面61の周線端から所定距離 だけ内側にある。

【0060】図8および図10において、バッケーシ本 体を形成するエンキャブスレーション料がリートの3を、め、452の下側表面88と2イバッ172の第1の差面8

その第2の表面64を除き全部覆っている。すなわら、 リート63の第3の表面66および第4の表面65はエ ンキャプスレーション材で覆われておりしたがってパッ ケージ内部にある。リードの切断端部がパッケージ側面 から延びている代替の実施例(例えば図5)では、エン キャプスレーンラン材はパッケージ側面から延びたりー 上切断部を覆っていない。

【0061】図11は図1の方法で製造可能なこの発明 によるもう一つのパッケージの断面図である。図11は 方形でなく円形の周縁を有し、相互接続用半田球ラント 10 図12の様11~11で見た断面を示す。ダイ52を憧 用のエポキシダイ接着剤87によりダイパット72の上 側の第1の表面82に付着させてある。ダイ52はダイ パッド72の風棒部を越え またパッケージ70のリー 172の上側の第1の表面76を越えて延びている。し たがって、パッケージ70の大きさはチップの大きさと ほぼ同じにある。ダイ52の側面52Aとパッケージ側 面17との間の距離はポンディングワイヤのある側では 約0、6ミリメートルほどにすぎない。代替の実施例 (図示してない) では、ダイ53はダイバッド72の周 【0057】四2のリード30の場合と同様に、図9の(20) 縁を越えて延びるが、リート73を越えて延びることは ない。もう一つの代替の実施例(図示してない) すな わちホンティンクワイヤがダイの4辺全部になく2辺だ けにある実施圏では、ポンティングワイヤの接続のない ダイ側面52Aとパッケージ辺との間の距離はごく小さ くり、1ミリメートルほどである。

[0062] 図11には四つのリード73が示してあ る。二つの内側のリード73の長さの一部だけがこの図 には示してある。これら内側のリードが図13のリート プレーム71で示すとおり慎方向曲げを含み、それらが、 二つの外側リード73の後方にあるからである。

【0.063】図11において、短いポンティンクワイヤ 71がダイちちの上のポンティングバット53の各っと リート73の上側の第1の平面76との間に接続してお る。ポンティンクワイヤ77の第1の表面76~の接続 はリート73の単1の雑86でパッケーシ側面79に輪 接して行う。

[0064] 図11のパッケージ70はボールグリット アレーバッケーンであるが、ラントグリップアレー(L GA)パッケージも可能である。図12に示すとおり 相互接続用半田球で8のアレーをバッケージで0の下側 外面80に形成する。したかって、互いに異なるリート 37の第2の表面74とバッケーシ側面79との間の距 難は変わり得る(図10多照)。

【0065】図11のパッケーシ本体81はモールトし たエンキャプスレーション村で形成するが、これ以外の エンキャプスレーション方法も可能である。図1の工程 4の麒麟中に、ダイち2の下側表面89とリートで3の 第1の表面との間をエンキャプスレーション付か過た ず、非導電性(すなわら絶縁性)の結署材エホキンを?

2との間に入れ ダイ52をダイバット72に付着さ せ、ダイ52をリード73の第1の表面76の上に関稿 を隔てて保持する。また ダイ52がリード73を越え て延びている場合は、追加の絶縁性エポキシ87をダイ 55の下側表面89とリート73の軍1の表面76との 間に入れ、ダイちちとリートで3との間に間隙を設け

【0066】図11のリート73の番々はほぼ平面状の 第1の表面76を有する。第1の表面76の反対側には 同様にほぼ平面状の第2の表面74 および第3の表面7 10 5がある。第2の表面74は各リード73の第1の鑑8 6と反対の第2の鑑85にある。これと対称的に 図6 のパッケージ50のリード30の第2の表面32の位置 および図8のパッケージ60のリート63の第2の表面 6.4 の位置はそれぞれのバッケージの下側外面の国珠上 またはその近傍にある。

{0067}図11において、各リート73の第3の表 面7.5はリード7.3の第2の表面7.4に隣接しその第2 ・ の表面74から深さ「Hl」だけ垂直方向に凹んでい る。この第3の表面75は垂直方向には第1の表面76~20~ と第2の表面74との間にあり、上述のとおり図3およ び図5のリード30の第3の表面33と同じ部分エッチ ング処理で形成する。図示のとおり エンキャプスレー ション材が第3の表面75を覆い、リート73がパッケ ージ本体81から垂直方向に引っ張られるのを防いでい る。エンキャブスレーション材はリート73の第2の表 笛を振っていない。

[0068]図11のパッケージ70の第パッド72は ほぼ平面状の第1の表面82を有する。第1の表面82 様のほぼ平面状の第3の表面84とかある。第3の表面 84は第2の長面83を取り囲みその長面83から降さ 【H1」だけ垂直方向に凹んでいる。 ダイバット72の 第1の表面82はリード73の第1の表面76と同じ水 平面内にある。

【0069】図11のダイパッド72の第3の表面84 は重直方向には第1の表面82と第2の表面83との額 にあり、図3および図5のダイパット22の第3の表面 23と同じ部分エッチング処理で形成する。図11に示 すとおり、エンキャプスレーション計かタイパットでで、40~る。図14の昔本的工程は図1の場合と同じてあり。し の第3の表面84を窺い。タイパット70が垂直方向に パッケージ本体81から引っ張られるのを紡いている。 エンキャプスレーション付はダイバットで2の第2の表 面を覆っていない。 パッケージ格却を容易にするため に、ダイパッド72の第2の表面83を半田辻または間 等の導体で外部の印刷配牌基板に接続することもてき る。代替的に「ダイバッド72を図1の工程4で上側に 設けて、ダイバッド72をエンキャプスレーション材で 寝いパッケージ本体81の内部に取り込むこともてき る。その場合は、リートで3の第1の表面でもはタイパーが、でて形成するリートでレームで1の数は変更できる。例

ット72の第1の表面82の下に位置づけられる。 【0070】図12は図11のパッケージ70の下側外 面80をリード73の第2の表面74に半田珠を配置す る前の状態で示した平面図である。図示のとおり 第2 の表面74は円形でありアレー状に配置されている。リ ート73の第3の表面75はこの図では見えない。すな わち 第3の表面75はエンキャプスレーション村で蓑 われ、したがってパッケージ本体81の内部にあるから である。全属の角板88を下側表面80の四つの角の各 ~に配置する。

20

[0071]図13は図118よび図12のパッケージ 7.0の製造に直したリードフレーム7.1の平面図であ る。図2の長方形のダイパッド22と異なり、図13の ダイパット72はダムバー29の互いに平行な二つの辺 に接続された分割型条片である。ダイバット72は四つ の長方影都分72を含み これら四つの部分をバッケー ジ治却のために印刷配根基板に半田様で接続する。

【0072】図13のリート73は用途に応じて多様な 形状および長さにできる。より詳細にいうと、リード7 3のいくつかはダムバー29から第2のリート後85 (図11) における円形の第2の表面74に至る展延部 で慎方向に真っ直ぐである。またそれらリート73の他 のいくつかはダムバー29と第2のリート鎌85(図1) 1)における第2の表面74との間で一つ以上の情方向 曲げ部を有する。リードフレーム71の各角部における 二つのリート73は同一のリート486に接続してある が、これは必須ではない。代替の実施例(図示してな し) では、リード73にエンキャプスレーション村との 格み合せのためのアンカー耳部を設ける。図1の工程6 の反対側には、同様にほぼ平面状の第2の表面83と周(30)において、各リート73を図13のダムパー29の内側 てリードフレーム7.1から切り離す。この切断はダムバ -29の内側で リートフレーム71の図13のWA-A B-B、C-CおよびD-Dにおける全居製魚部は 88の建の外側で行う。

[0073]上述のバッケージ、リートフレーム 組立 て方法などには、この明細雲に基づき多数の変形が可能 であることは当業者に明らかであろう。例えば 図14 は、複数のパッケージを図り、図10または図11に従 って同時並行的に製造する代替組立て方法の流れ図であ たかって、各工程の詳細な説明は不要であるう。図1の 処理と図14の処理との差は複数パッケージの同時並行 製造を可能にするようにする工程が改変されていること たけである。図14の処理は工程1においてリートでし ーム20、62 71などの複数のリートフレームを一 つの金属条片シート上にマトリクスの形でエッチレグに より近接形成することによって可能になる。

(**) 0 7 4) 図) 5 は全属条片 9 0 上の 1 2 個の リート アレームで1のマトリクスを示す。条片90にエッチン

えば、条片91に36個または64個のリートフレーム 91をエッチングで形成できる。リートフレーム91 は、上述の2段階エッチング手法または2段階順送りス タンピングおよび化学エッチング手法を用いて 条片9 ()に同時並行的にエッチングで形成したものである。図 15の形状については、図14の工程4を上述のとおり 慣用のモールト手法を用いて行い、条片90の各リート フレーム71上の個々のパッケージ本体81を形成てき る。すなわち 型は各ダイに対して個々の型空網を確 え、図4の場合と間様に個々の不完全なパッケージのア 10 レーを形成する。工程6はパンチまたは鋸を用いて個々 のパッケージを条片9(1から切断する。

[0075]図16は8個のリードフレーム20(図 2) の二つのマトリクスをエッチングにより形成する代 替の条片93を示す。図14の工程4の期間中に置っの パッケージをモールトする代わりに 二つのマトリクス の各々のリードフレーム20全体にわたってエンキャブ スレーション村の1プロックを建布する。 これらエンキ ャプスレーション材のプロックは、図16のリードフレ ーム20の各マトリクスの周囲にHYSOL4451様 20 若剤ビーズをまず塗布することによって行う。ビーズ硬 化ののち、HYSOL4450液状エンキャプスレーシ ョン村またはその同等品をピーズ内に低布し、各ダイ5 2およびダム内側の加工中のパッケージ50をエンキャ プスレーション村で覆うようにする。次に、エンキャブ スレーション封を加熱などにより硬化させ、リードフレ ーム20の二つのマトリクスの各々の上にエンキャプス レーション材の連続したプロックを形成する。図14の 工程6では、8個の別々のバッケージ50を二つの条片 93の各々から切り離すのに蛯を用いる。工程6はリー ドフレーム20とダイパッド22とリード30との間を 切断する。また 工程6は直交状パッケージ側面を形成 するようにエンキャフスレーション村を切断する。

【0076】この発明の実施例の上述の説明は例示のた めのものであって限定を意図するものではない。この明 細書から、上記以外の実施例が当業者には目明である

【図画の哲学な説明】

- 【図】】パッケージ製造方法の流れ図。
- 【図2】 パッケージ製造に用いるリートフレームの平面 40 5.3 ポンティングパッド5.4 ポンティングワイヤ
- 【図3】図2の棟3-3でダムバーの内側を見たタイパ

ットおよびリートの断面図。

[四4] 図2のリートフレームのモールトしたエンキャ プスレーション村によるダイ付着およびエンキャプスレ ーション後の斜切尾。

22

【図5】パッケ・ン羌成品 すなわちハッケーシ本体を モールドしてパンチによりリートフレームから分離した。 バッケージ完成品の断面図。

【図6】リードの露出部分に半田パンプを付着させたあ との図りのパッケージの断面図。

【図7】図5のバッケージ下側表面の平面図。

【図8】代替バッケージの下側表面の平面図。

【図9】図8のバッケージの製造のためのダイバットお よびリードのダムバーの内側で見た断面図。

【図10】図8のパッケージの新面図。

【四11】ダイがダイパット周辺から様方向にリートの 長さの一部を越えてはみ出して延びている代替的パッケ ーンの断面図。

【図12】相互接続用半田球を備えない図12のバッケ ージの下側表面の平面図。

【図13】図11および図12のパッケージの製造のた めのリードフレームの平面図。

【図14】接数のパッケージを同時並行的に製造する方 きの走れ図。

【図15】全国条片のエッチングで形成した6個のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【図16】全国条片のエッチングで形成した8回のリー トフレームの二つのマトリクスの平面図。

【符号の説明】

21 タイバー 20 リードフレーム 23 第1の表面 22 ダイパッド

25 第3の表面 24 第2の表面

27 第2の直交側面 26 第1の直交側面

29 ダムバー 2.8 接続級

31 第1の表面 30 9-1

33 第3の表面 32 第2の表面

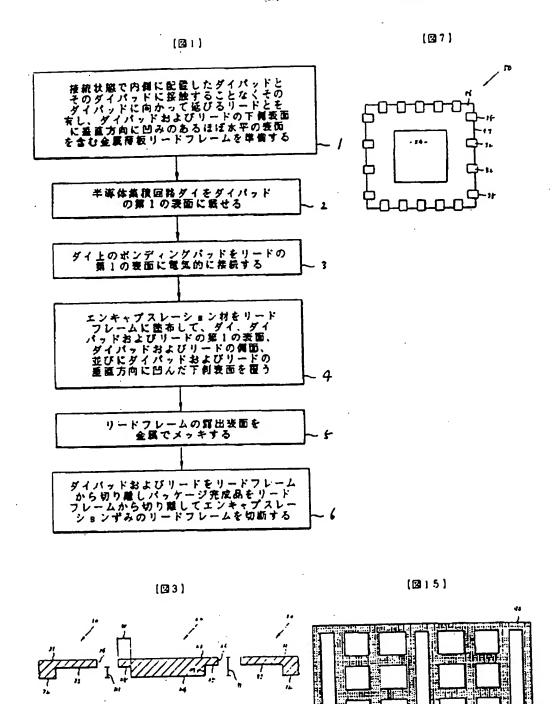
3.5 曲げ雑都 34 リート先権

50, 60 70 495-36 アンカー耳部

51 パッケージ本体 52 91

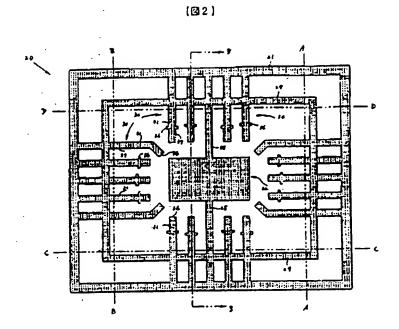
55 側面56 下側表面

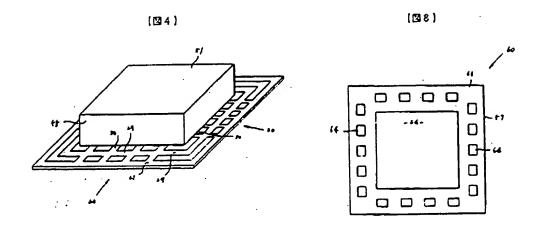
78 半田は



特別2000-150765

(14)

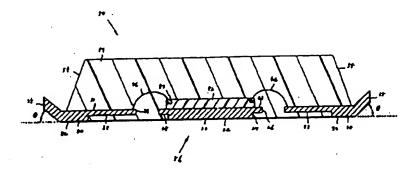




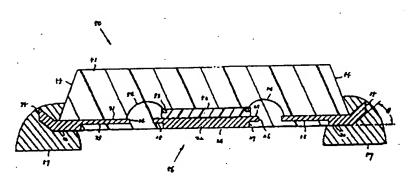
(15)

特別2000-150765

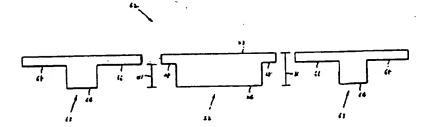
(図5)



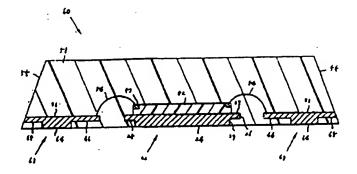
[26]



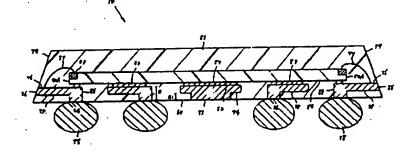
(**29**)



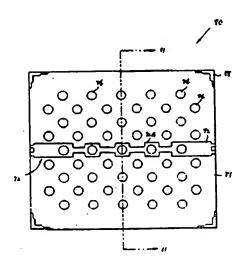
[210]



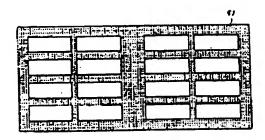
(**311**)



[2]12]



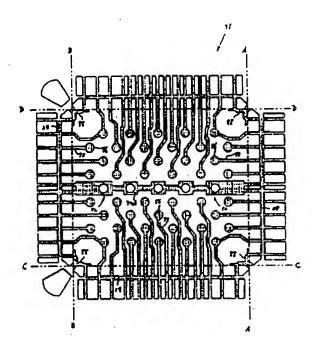
[2]16]



特闘2000-150765

(17)

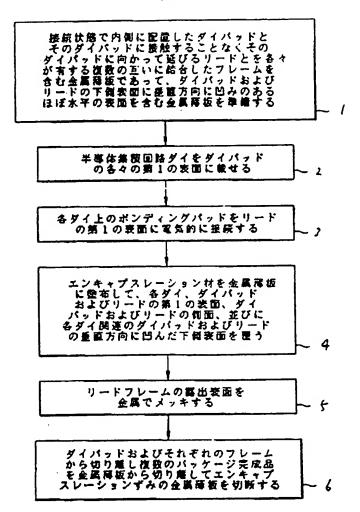
[213]



3/3/03 9 38 4

copy a service feet garge open

[214]



フロントページの続き

(72)発明者 トーマス ビー、グレン アメリカ台衆国 アリソナ州 85233 キ ルハート、サウス クラウン キー コー ト 1001

(72)発明者 スコット ジェイ、ジュウラー アメリカ台京国 アリソナ州 85296 キ ルパート、イースト アラヒアン コート 1436 (元)発明者 ディクテッド ロマン アメリカ合衆国 エリソナ州 85084 デ ンプル、ウェスト バロミーノ トライフ 428

(元)発明者 シェイ、エッチ、イー 、検国 ソウル、カンドン・ク、アムサートン カントンアパートメント 7-202

(19)

行間2000-150765

(72)発明者 ディー、エッチ、ムン 軽国 ソウル、クッンジンーク、クンジャ -ドン 465-7

3/3/03 9 38 Alk